(19) 世界知的所有権機関 国際事務局





(43) 国際公開日 2005 年6 月16 日 (16.06.2005)

PCT

(10) 国際公開番号 WO 2005/054883 A1

(51) 国際特許分類⁷: G01R 31/3183

(21) 国際出願番号: PCT/JP2004/017970

(22) 国際出願日: 2004年11月26日(26.11.2004)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ: 特願2003-402159 2003年12月1日(01.12.2003) J

- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 富士通テン株式会社 (FUJITSU TEN LIMITED) [JP/JP]; 〒6528510 兵庫県神戸市兵庫区御所通1丁目2番28号 Hyogo (JP).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人(米国についてのみ): 石尾 雅人(ISHIO, Masato)[JP/JP]; 〒6528510 兵庫県神戸市兵庫区御所通1丁目2番28号富士通テン株式会社内 Hyogo (JP).

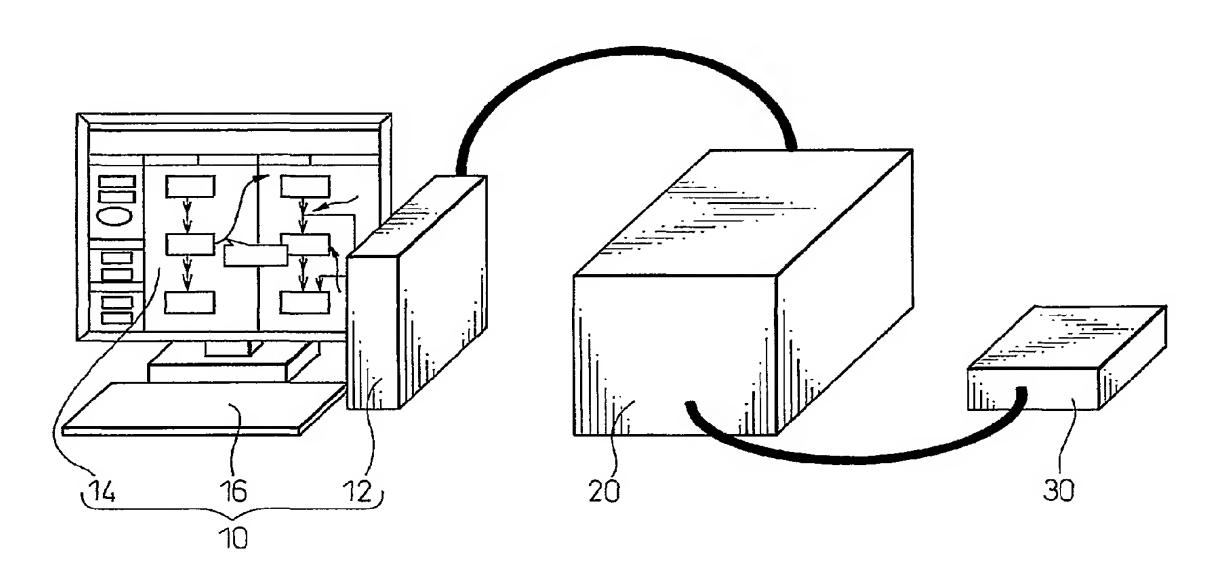
久井茂幸(HISAI, Shigeyuki) [JP/JP]; 〒6528510 兵庫県神戸市兵庫区御所通1丁目2番28号富士通テン株式会社内 Hyogo (JP). 網江岳朋 (AMIE, Taketomo) [JP/JP]; 〒6528510 兵庫県神戸市兵庫区御所通1丁目2番28号富士通テン株式会社内 Hyogo (JP). 内橋浩二(UCHIHASHI, Koji) [JP/JP]; 〒6528510 兵庫県神戸市兵庫区御所通1丁目2番28号富士通テン株式会社内 Hyogo (JP).

- (74) 代理人: 青木 篤, 外(AOKI, Atsushi et al.); 〒1058423 東京都港区虎ノ門三丁目 5 番 1 号 虎ノ門 3 7 森ビル 青和特許法律事務所 Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG,

[続葉有]

(54) Title: CONTROL DEVICE INSPECTION DEVICE, PATTERN SIGNAL GENERATION DEVICE, AND INSPECTION PROGRAM CREATION DEVICE

(54) 発明の名称:制御装置の検査装置、パターン信号作成装置及び検査プログラム生成装置



(57) Abstract: There is provided a device for supporting creation of an inspection program executed by a simulator which automatically inspects an electronic device. The device reduces the number of preparation work steps in automatic inspection and improves reliability. The device is an inspection device including: a simulation unit for simulating a control object of a control device; and an inspection unit for inspecting the operation of the control device according to the relationship between a pattern signal inputted to the control device and an output signal outputted from the simulation unit in accordance with the pattern signal. The inspection unit inspects operation of the control device at a predetermined timing and performs retry judgment by a predetermined number of times when judgment that operation of the control device is normal cannot be obtained.

SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CII, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, IIU, IE, IS, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI

(BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

一 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される 各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語 のガイダンスノート」を参照。

(57) 要約: 電子機器を自動検査するシミュレータで実行される検査プログラムの作成を支援する装置であって、自動検査における準備作業工数の低減及び信頼性の向上を図る装置。この装置は、制御装置の制御対象を模擬するシミュレートユニットと、その制御装置に入力するパターン信号と該パターン信号に応じてシミュレートユニットから出力される出力信号との関係に基づいて、制御装置の動作を検査する検査ユニットと、を備えた検査装置であって、検査ユニットは、所定のタイミングで制御装置の動作を検査するものであり、制御装置の動作が正常であるとの判定が得られない場合には、所定回数のリトライ判定を行う。

明 細 書

制御装置の検査装置、パターン信号作成装置及び検査プログラム生成装置

技術分野

本発明は、電子機器の動作環境を模擬して自動検査するシミュレータにおいて実行される検査プログラムの作成を支援する装置(制御装置の検査装置、パターン信号作成装置及び検査プログラム生成装置)に関する。

背景技術

車両に搭載される電子制御装置(ECU: Electronic Control Unit)等の電子機器を検査・評価するために、その電子機器の動作環境を模擬して自動検査するシミュレータが使用されている。かかるシミュレータを動作させる検査プログラムは、人手によって作成された検査仕様書に基づき人手によって検査パターン、判定ロジック等を作成することにより、準備されている。

このように、検査プログラムの準備においては、検査パターン、 判定ロジック等が人手によって作成されるため、作業工数及び信頼 性の面で問題がある。特に、検査仕様書を作成した担当者とは別の 担当者が検査パターン、判定ロジック等を作成する場合には、その 問題が大きくなる。

発明の開示

本発明は、上述した問題点に鑑みてなされたものであり、その目的は、電子機器を自動検査するシミュレータで実行される検査プロ

グラムの作成を支援する装置を提供することにより、自動検査における準備作業工数の低減及び信頼性の向上を図ることにある。

上記目的を達成するために、本発明によれば制御装置の制御対象を模擬するシミュレート手段と、前記制御装置に入力するパターン信号と該パターン信号に応じて前記シミュレート手段から出力される出力信号との関係に基づいて、前記制御装置の動作を検査する検査手段と、を備え、前記検査手段は、所定のタイミングで前記制御装置の動作を検査するものであり、前記制御装置の動作が正常であるとの判定が得られない場合には、所定回数のリトライ判定を行う、制御装置の検査装置、が提供される。

また、本発明によれば、パターン信号を作成するパターン信号作成装置であって、前記パターン信号作成装置によって作成された前記パターン信号を用いる装置の制御周期に基づいて、前記パターン信号を作成する第1の関数処理手段と、前記制御周期とは異なる周期に基づいて、前記パターン信号を作成する第2の関数処理手段と、を備えるパターン信号作成装置が提供される。

ここで、本発明によれば、好ましくは、前記第2の関数処理手段は、複数の前記制御周期にわたる時間の周期に基づいて、前記パターン信号を作成する。

また、好ましくは、前記第2の関数処理手段は、前記制御周期毎の周期に基づいて、前記パターン信号を作成する。

また、本発明によれば、パターン信号を作成するパターン信号作成装置であって、基準パターン信号に対する相関情報が指定された相関パターン信号を作成する手段と、該基準パターン信号と作成された該相関パターン信号とを同一画面上に表示する表示手段と、を備えるパターン信号作成装置が提供される。

また、本発明によれば、パターン信号を作成するパターン信号作

成装置であって、基準パターン信号に対する相関情報が指定された 相関パターン信号が存在する場合に、該基準パターン信号と該相関 パターン信号とを同一画面上に表示する表示手段と、前記基準パタ ーン信号の変更と連動させて該相関パターン信号を変更するパター ン信号連動変更手段と、を備え、前記表示手段は、前記基準パター ン信号の編集が行われた場合には、前記基準パターン信号とともに 、前記パターン信号連動変更手段によって変更された前記相関パターン信号の再表示を行うパターン信号作成装置が提供される。

また、本発明によれば、制御装置にデータの出力を行わせるダイアグ機能の検査を行うための検査プログラムを作成する検査プログラム作成装置であって、前記制御装置で処理される前記パターン信号を画面上に表示する手段と、前記パターン信号が画面上に表示された状態で、前記ダイアグ機能の検査における設定を可能とする手段と、を備える検査プログラム作成装置が提供される。

ここで、本発明によれば、前記ダイアグ機能の検査における設定とは、前記制御装置に対するデータ出力要求情報および該データ出力要求情報を前記制御装置に要求した場合におけるダイアグ機能の正常もしくは異常の判定条件である。

また、本発明によれば、検査プログラムを作成する検査プログラム作成装置であって、制御装置に入力するパターン信号と該パターン信号間の遷移条件とを含む子プロジェクトと、前記子プロジェクトと前記子プロジェクト間の遷移条件とを含む親プロジェクトと、前記子プロジェクトの編集画面と、前記親プロジェクトの編集画面とを同時に表示する表示手段と、前記表示手段に表示された前記親プロジェクトの編集画面における前記子プロジェクトを選択すると、該選択された子プロジェクトの内容を前記子プロジェクトの編集画面に表示し、編集可能とする第1の編集手段と、前記表示手段に

3

表示された前記子プロジェクトの編集画面における前記子プロジェクトの内容を選択すると、該選択された前記子プロジェクトの内容の設定情報を新たな編集画面に表示し、編集可能とする第2の編集手段と、を備える検査プログラム作成装置が提供される。

また、本発明によれば、制御装置の検査装置であって、前記制御装置に入力するパターン信号と該パターン信号に応じて前記制御装置の制御対象から出力される出力信号との関係に基づいて、前記制御装置の動作を検査する検査手段と、前記検査手段が前記パターン信号を実行しているときに他の前記パターン信号の実行に移行するためのパターン信号遷移条件が成立した場合に、前記検査手段を該他の前記パターン信号の実行に移行させる手段と、を備える、制御装置の検査装置が提供される。

本発明によれば、検査パターン等の作成が容易となり、準備作業 工数が低減するとともに、作成される検査プログラムの信頼性が向 上する。

図面の簡単な説明

図1は、本発明による電子機器自動検査プログラム作成支援装置を含む電子機器自動検査システムの構成例を示す図である。

図2は、支援装置によって実行される判定リトライ設定処理の手順を示すフローチャートである。

図3は、8ms更新カウンタに対する判定リトライ設定処理によって生成されシミュレータによって実行されるリトライ判定処理の手順を示すフローチャートである。

図4は、図3のリトライ判定によって8ms更新カウンタについての判定がなされていく様子を例示する図である。

図5A、5B及び5Cは、支援装置によって生成される正弦波信

号を例示する図である。

図6は、支援装置によって実行されるSin信号作成処理の手順を示すフローチャートである。

図7は、相関信号を定義するための画面表示の例である。

図8は、相関信号のタイムチャートを例示する図である。

図9は、支援装置によって実行される相関信号作成処理の手順を示すフローチャートである。

図10は、支援装置によって実行される信号パターン作成処理の 手順を示すフローチャートである。

図11は、通信データ設定画面を例示する図である。

図12は、支援装置によって実行される通信イベント信号作成処理の手順を示すフローチャートである。

図13は、シミュレータによって実行される通信機能検査処理の 手順を例示するプログラムである。

図14は、検査パターン間状態遷移設定機能を実現する機能構成(ソフトウェア構成)の例を示す図である。

図15は、状態遷移設定画面を例示する図である。

図16は、チャート画面を例示する図である。

図17は、遷移条件設定画面を例示する図である。

図18は、支援装置によって実行される状態遷移設定処理の手順 を示すフローチャート(1/2)である。

図19は、支援装置によって実行される状態遷移設定処理の手順を示すフローチャート(2/2)である。

図20は、シミュレータによって実行される自動検査処理の手順 を示すフローチャートである。

発明を実施するための最良の形態

以下、添付図面を参照して本発明の実施形態について説明する。

図1は、本発明による電子機器自動検査プログラム作成支援装置 10を含む電子機器自動検査システムの構成例を示す図である。同 図に示されるように、このシステムは、電子機器自動検査プログラ ム作成支援装置10、シミュレータ20及び電子機器30から構成 される。

電子機器30は、自動検査の対象であり、本実施形態では、車両に搭載される電子制御装置(ECU: Electronic Control Unit)である。シミュレータ20は、ECU30の動作環境を模擬して自動検査するコンピュータである。自動検査プログラム作成支援装置(以下、支援装置と略称する)10は、シミュレータ20において実行される検査プログラムの作成を支援する装置であり、コンピュータ本体(CPU、記憶装置等を備える)12、ディスプレイ14、キーボード16等からなる通常のパーソナルコンピュータによって実現される。

支援装置10は、基本的には、ユーザによる画面上での入力操作に基づいて、すなわちGUI(Graphical User Interface)により、ECU30に対する検査仕様を入力し、その検査仕様に基づいて検査パターン(ECU30への入力信号、その入力信号に応答してECU30から出力される信号が正常か否かを判定するための判定ロジック、等を含む。)を生成する。

図1に示される構成の自動検査システムの下では、シミュレータ20の実行周期ごとにECU30内のRAM(Random Access Memory)の値を自動判定する場合、ECU30がRAM値を更新するタイミングとシミュレータ20がRAM値をサンプリングするタイミングとの間にズレが生ずるため、誤判定が生ずる可能性がある。そこで、支援装置10は、判定ロジックを生成する際の機能の一つと

6

して、判定リトライ機能をサポートしている。この判定リトライ機能は、リトライ回数の設定を可能とし、一度NG判定がなされたとしても、直ぐにはNGを確定させることはせず、指定されたリトライ回数だけリトライ判定することで誤判定の防止を図るものである

図2は、支援装置10によって実行される判定リトライ設定処理の手順を示すフローチャートである。まず、ステップ52では、リトライを行う判定並びにそのリトライ回数及びリトライ周期を設定するための判定リトライ設定画面を表示する。次いで、ステップ54では、リトライ判定に関する各種の条件を設定する処理を行う。例えば、ユーザは、この画面を介して、ECU30内の8ms更新カウンタの判定に関してリトライを設定することを指定し、さらにそのリトライ回数として2回、リトライ周期として1msを設定することができる。最後に、ステップ56では、判定リトライ設定画面をクローズする。

図3は、例示した8ms更新カウンタに対する判定リトライ設定処理によって生成されシミュレータ20によって実行されるリトライ判定処理の手順を示すフローチャートである。この処理においては、まず、ステップ62において、リトライ回数を計数するリトライカウンタが2であるか否かを判定する。なお、このリトライカウンタが2であるイニシャル処理で2に初期設定される。リトライカウンタが2であれば、ステップ64に進み、判定処理(通常の判定処理)、すなわち8ms更新カウンタが正常に更新されているか否かを判定する処理を行う。ステップ66では、"〇"(OK)判定であったかどうかを判断し、"〇"判定の場合にはステップ68にてリトライカウンタをデクリメントした後、本ルーチン

を終了する。

ステップ62においてリトライカウンタが2でないと判定された場合には、ステップ70に進み、リトライカウンタが1であるか否かを判定する。リトライカウンタが1であれば、ステップ72に進み、判定処理(1回目のリトライ判定処理)を行う。ステップ74では、"〇"判定であったかどうかを判断し、"〇"判定の場合には、ステップ76においてリトライカウンタを2に戻して本ルーチンを終了する一方、"×"判定の場合には、ステップ78においてリトライカウンタを更にデクリメントして本ルーチンを終了する。

ステップ70においてリトライカウンタが1でないと判定された場合には、ステップ80に進み、判定処理(2回目のリトライ判定処理)を行う。ステップ82では、"〇"判定であったかどうかを判断し、"〇"判定の場合には、本ルーチンを終了する一方、"×"判定の場合には、ステップ84において"×"判定を確定させる処理を行うとともに、ステップ86においてリトライカウンタを2に戻した後、本ルーチンを終了する。

図4は、図3のリトライ判定処理によって、8ms更新カウンタについての判定がなされていく様子を例示する図である。同図に示されるように、一度NG判定がなされたとしても、直ぐにはNG判定を確定させることはせず、再度指定されたリトライ回数(この例では2回)だけリトライ判定が行われる。この判定リトライ機能によって、誤判定が防止されるとともに、判定ロジックにおける監視式(判定の合否を決定するための式)の設定機能の向上が図られる

ところで、支援装置10では、ユーザがECU30に対する検査パターンを生成するのを支援するために、時間を変数とするパターン信号編集関数を準備し、指定された関数に応じてパターン信号を

8

生成する機能を備えている。ここで、検査ステップ毎の時間変数でしかパターン信号を記述することができない場合には、ステップを跨いだパターン信号を表現しても、信号のつながりが不連続となり、任意のパターン信号を記述することができないという問題がある。すなわち、例えば、ステップ内の経過時間\$Tを用いて\$in信号\$y\$sin(\$)を記述した場合には、図\$5Aに示されるようになる。

そこで、支援装置10では、ステップ内の時間変数だけでなく、複数ステップ間における時間に関する変数を用意することで、不連続点なくステップ間を跨ぐパターン信号についても任意に設定することができるようにしている。例えば、開始時からの経過時間\$SYSTEMTIMEを用いてSin信号y=sin(ω(\$SYSTEMTIME))を記述することができ、図5Bに示されるような信号を生成する。

また、ステップ毎の時間変数でSin波形を記述しようとする場合、ステップ毎に周期を変えてSin信号を記述することができないと、任意のSin波形を発生させることができない。そこで、支援装置10では、周期が一定となるy=sin(($2\pi/t$)(\$T))なる記述を拡張し、変数STEPによって周期を任意に設定可能なy=sin(($2\pi/STEP$)(ST))なる記述をもサポートすることで、図SCEできるように、周期をステップ毎に変更することができるようにしている。

図6は、支援装置10によって実行されるSin信号作成処理の手順を示すフローチャートである。まず、ステップ102では、入力されたSin関数が複数ステップ間にわたる記述であるか否かを判定する。複数ステップ間にわたるものでない場合には、ステップ104に進み、変数Tに入力\$Tを代入する一方、複数ステップ間

にわたるものである場合には、ステップ106に進み、変数Tに入力\$SYSTEMTIMEを代入する。

次いで、ステップ108では、ステップ毎の周期設定か否かを判定する。ステップ毎の周期設定でない場合には、ステップ110に進み、角周波数 ω を 2π / t とする一方、ステップ毎の周期設定である場合には、ステップ112に進み、角周波数 ω を 2π / t S T E P とする。次いで、ステップ114では、先行するステップで求められた T 及び ω を用いて S i n 信号 y = s i n (ω T)を作成し、最後に、ステップ116において、作成された S i n 信号を画面上に描画する。このように、時間に関する変数が拡張されたことにより、S i n 信号において任意の波形を設定することが可能となり、パターン信号編集機能が向上する。

ところで、相関して変化する二つ以上のパターン信号を作成する際、別々に設定することとなると、工数が増大するとともに、それらの信号を変更する際にも、同様の工数増加が発生する。そこで、支援装置10では、相関する二以上の信号については、基準となる信号を指定し、その信号に対してオフセットや係数を設定することで、関連して変化する二つ以上のパターン信号を作成することができるようにしている。

具体的には、図7に示されるように、パターン信号編集画面における関数入力機能を利用して、信号Bを信号A*36と定義した場合には、図8に示されるように、信号Aを36倍することにより信号Bが自動的に作成されるとともに、信号Aについて修正が施された場合には、信号Bについて同様の修正が自動的になされる。

図9は、支援装置10によって実行される上述した相関信号作成 処理の手順を示すフローチャートである。まず、ステップ132で は、基準信号としての信号Aの指定を受け付ける。次いで、ステッ

プ134では、指定された関数式に基づいて基準信号*36なる演算によりyを求める。最後に、ステップ136では、演算結果yを用いて信号Bを作成する。かくして、関連する複数の信号を容易に作成することが可能となり、パターン信号変更時においても工数の低減が図られる。

図10は、支援装置10によって実行される信号パターン作成処理の手順を示すフローチャートである。まず、ステップ152では、信号の条件を設定するための画面を表示する。次いで、ステップ154では、画面上での入力に基づき各種条件を設定する。次いで、ステップ156では、条件設定画面をクローズする。そして、ステップ158では、作成した信号が他信号を利用しているか否か、すなわち前述のように他信号を用いて記述されているか否か、を判定する。他信号を利用している場合には、ステップ160に進み、作成した信号と利用された他信号とを同時に描画する一方、他信号を利用していない場合には、ステップ162に進み、作成した信号を利用していない場合には、ステップ162に進み、作成した信号についてのみ描画処理を行う。以上で、信号パターン作成処理が終了する。

ところで、一般に、ECU30はダイアグ機能を備えている。かかるダイアグ機能を検査するために、通信データの設定や判定値の設定を行うにあたり、それぞれ別々の画面で設定することとなれば、その工数が増大する。そこで、支援装置10では、検査対象のECU30への送信データ及びその送信タイミング並びに当該送信データに応じてECU30から受信されるべき受信データ理論値を設定することにより、ECU30への送信データの自動送信の実行及びECU30からの受信データの合否判定を行う機能を備えている

この機能は、送信データ、送信タイミング及び受信データ理論値

を、同一画面上で、ECU30の他の入出力信号チャート(電圧、スイッチ、デューティ等)とともに記載することができるようにして検査仕様全体をみわたすことができるようにし、ダイアグ機能の検査に関する設定(送信データ、送信タイミング、受信データ)を行うGUI機能である。

具体的には、図11に示されるように、信号パターン編集画面上で、通信イベントタイミング信号としての特定の信号に設定されたイベントマーク(中黒三角)をクリックすると、通信データ設定画面のウィンドウが表示され、当該特定の信号に関連する送信メッセージ及び受信メッセージ(理論値)の設定が可能となる。送信タイミングは、クリックされたイベントマークの位置に応じて自動的に生成される。

図12は、支援装置10によって実行される通信イベント信号作成処理の手順を示すフローチャートである。まず、ステップ182では、図11に示されるような、通信イベントの条件設定画面を表示する。次いで、ステップ184では、GUIによる入力に基づいて各種の条件(送信メッセージ、送信タイミング、受信メッセージ理論値)を設定する。次いで、ステップ186では、条件設定画面をクローズする。最後に、ステップ188では、作成した通信イベントの描画処理を行うとともに、シミュレータ20によって実行可能なダイアグ機能検査処理プログラムを作成する。

図13は、シミュレータ20によって実行されるダイアグ機能検査処理の手順を例示するフローチャートである。この処理は、検査対象のECU30へ送信データ0x10を送信し、ECU30から受信データ0x20が返されてくることを確認するものである。まず、ステップ202では、検査対象ECUへデータ0x10を送信する。次いで、ステップ204では、検査対象ECUからデータが

受信されたか否かを判定する。受信されていない場合には、ステップ206に進み、タイムオーバーか否かを判定し、タイムオーバーでない場合には、ステップ204に戻る。

ステップ204で検査対象ECUからの受信データがあった場合には、ステップ208でその判定処理を行い、ステップ210で受信データが0x20か否かをチェックする。受信データが期待値たる0x20である場合には、ステップ212においてOK判定時の処理を行う一方、受信データが期待値と異なる場合には、ステップ214に進み、NG判定時の処理を行う。また、ステップ206でタイムオーバーと判定された場合にも、ステップ214にてNG判定時の処理を行う。

かくして、一画面で通信に関する検査内容を容易に且つ信頼性を 有して設計することが可能になるとともに、ダイアグ関連の自動検 査に関する設計工数の低減が図られる。

ところで、類似した目的の検査を行う際には、共通の検査項目は一個のファイルとして保存しておき、再利用することができるようにすることが好ましい。そこで、支援装置10では、検査パターン間の状態遷移設定機能を設けることにより、共通検査項目の再利用を可能にしている。

図14は、かかる状態遷移設定機能を実現する機能構成(ソフトウェア構成)の例を示す図である。支援装置10の自動検査パターンエディタには、プロジェクト編集機能とプロジェクト保存・読出機能とを備える自動検査プロジェクト設定機能(親)が設けられる。また、この自動検査プロジェクト設定機能(親)の内部には、同様に、プロジェクト編集機能とプロジェクト保存・読出機能とを備える自動検査プロジェクト設定機能(子)が設けられる。そして、この自動検査プロジェクト設定機能(子)の内部には、自動検査パ

ターン設定機能と遷移条件設定機能とが設けられる。自動検査パターン設定機能はパターン編集機能とパターン保存・読出機能とを備え、遷移条件設定機能は遷移条件編集機能を備える。一方、シミュレータには、自動検査パターン実行機能が設けられ、この自動検査パターン実行機能の内部には、遷移条件監視機能とパターン切り換え機能とを備える自動検査パターン遷移機能が設けられる。

上述の機能構成に基づいて、状態遷移設定機能は、設計された一つの検査パターンを一つのファイル(以下、パターンファイルと称する)として保存し、保存されたパターンファイルを読み出して、再度編集したり別の名称で再度保存する機能を実現する。また、状態遷移設定機能は、自動検査パターンエディタにて設計された検査パターン1と別の目的で設定された検査パターン2とに対して、検査パターン1がシミュレータ上で自動実行されているときに、別に設定された条件(以下、パターン遷移条件という)が常時監視され、遷移条件が成立した場合に検査パターン2の実行に移行する機能を実現する。

また、状態遷移設定機能は、かかるパターン遷移条件をGUIで設定することができるようにし、検査パターン1、検査パターン2及びパターン遷移条件の組み合わせ情報を、任意の名称のプロジェクトとしてファイル(以下、プロジェクトファイルと称する)に保存し、保存されたプロジェクトファイルを読み出して、再度編集したり別の名称で再度保存する機能を実現する。

また、状態遷移設定機能は、前述したプロジェクトを複数設計し、複数のプロジェクト間についてもパターン遷移条件と同様のプロジェクト遷移条件を設定することで、プロジェクト間の状態遷移がシミュレーション環境で実行される機能を実現する。

そして、状態遷移設定機能は、プロジェクト遷移条件を設定する

ための欄を親としパターン遷移条件を設定するための欄を子とする 階層構造を有して一つの画面上に当該二つの欄を同時に表示するこ とにより、一度に両遷移条件の設定及びプロジェクト/パターンの 組み合わせ設定が編集可能な機能を持つGUIを実現する。

具体的な例として、状態遷移設定画面を例示する図が図15に示される。画面左側の「設定1」の欄には、プロジェクトとしての「状態A」、「状態B」及び「状態C」の各状態(プロジェクトに係る状態を「グループ」と称する。)ブロックが配置されている。「状態A」、「状態B」及び「状態C」の各状態(「グループ」)ブロック間に配置された丸印(〇)のノードは、プロジェクト遷移条件を表す。この「設定1」により複数のプロジェクトとプロジェクト遷移条件とからなる検査プログラムの編集が可能となる。

一方、画面右側の「設定2」の欄には、現在アクティブな状態(「グループ」)ブロックである「状態B」の設定内容を表示すべく、「状態B」を構成する検査パターンとしての「状態ア」、「状態イ」及び「状態ウ」の各状態(検査パターンに係る状態を「詳細」と称する。)ブロックが配置されている。「状態ア」、「状態イ」及び「状態ウ」の各状態(「詳細」)ブロック間に配置された丸印(〇)のノードは、パターン遷移条件を表す。この「設定2」により複数の検査パターンとパターン遷移条件とからなるプロジェクトの編集が可能となる。

図15に示される画面において、例えば、状態(「詳細」)ブロックとしての「状態イ」をダブルクリックすると、図16に示されるような、「状態イ」に係る検査パターンの各信号を表示するチャート画面が現れ、その内容を編集することが可能となる。

また、「状態ア」と「状態イ」との間に配置された丸印(〇)の ノードをダブルクリックすると、図17に示されるような、そのパ

ターン遷移条件に係る遷移条件設定画面が現れ、その内容が表示される。この遷移条件設定画面の例は、「状態ア」にあるときには、「Event1」が発生すると「状態イ」に遷移する一方、「Event2」が発生すると「状態ウ」に遷移することを表している。この画面により、パターン遷移条件の設定や変更が可能となる。また、プロジェクト遷移条件についても同様である。

図18及び図19は、支援装置10によって実行される状態遷移設定処理の手順を示すフローチャートである。まず、ステップ302では、プロジェクトファイルの新規作成か否かを判定し、新規作成の場合には、ステップ308に進む。一方、新規作成でない場合には、ステップ304で既存のプロジェクトファイルを読み出し、ステップ306でその描画処理を行った後、ステップ308に進む

ステップ308では「グループ」の作成・編集か否かを判定し、「グループ」の作成・編集の場合にはステップ310にて既存の「グループ」の流用か否かを判定する。流用の場合のみステップ312において流用元のパターンファイルの読出しを行う。次いで、ステップ314ではユーザの入力に応じて「グループ」の設定を行い、ステップ316では設定された「グループ」記号の描画を行う。

ステップ308で「グループ」の作成・編集ではないと判定された場合には、ステップ318に進み、いずれかの「グループ」の指定か否かを判定する。「グループ」の指定の場合には、ステップ320に進み、指定された「グループ」の内容を「設定2」画面に表示する。

ステップ318にて「グループ」の指定ではないと判定された場合には、ステップ322に進み、「詳細」の作成・編集か否かを判定する。「詳細」の作成・編集の場合には、ステップ324でユー

ザの入力に応じて「詳細」の設定を行い、ステップ326では設定された「詳細」記号の描画を行う。次いで、ステップ328でチャート画面(図16)の表示、ステップ330でチャート編集処理をそれぞれ行った後、ステップ332でチャート画面をクローズする

ステップ322において「詳細」の作成・編集ではないと判定された場合には、ステップ334に進み、「遷移条件」の作成・編集か否かを判定する。「遷移条件」の作成・編集の場合には、ステップ336で「遷移」記号の描画を行う。次いで、ステップ338で「遷移条件」設定画面(図17)の表示、ステップ340で「遷移条件」設定処理をそれぞれ行った後、ステップ342で「遷移条件」設定画面をクローズする。

ステップ334において「遷移条件」の作成・編集ではないと判定された場合には、ステップ344に進み、その他の編集処理を実行する。ステップ316、320、332、342又は344の実行後には、ステップ346に進み、編集作業が全て終了したか否かを判定し、終了していない場合には、ステップ308にループバックする。一方、終了した場合には、ステップ348においてプロジェクトファイル及びパターンファイルを保存して、本ルーチンを終了する。

図20は、上述した状態遷移設定処理を経て作成された検査プログラムに従ってシミュレータ20により実行される自動検査処理の手順を示すフローチャートである。まず、ステップ402において自動検査パターンの実行が開始されると、ステップ404においてプロジェクト遷移条件が成立するか否かが判定される。プロジェクト遷移条件が成立する場合には、ステップ406において実行(遷移先)プロジェクトが更新される。

次いで、ステップ408においては実行プロジェクトが選択される。次いで、ステップ410においてパターン遷移条件が成立するか否かが判定される。パターン遷移条件が成立する場合には、ステップ412において実行(遷移先)パターンが更新される。

そして、ステップ414においては実行パターンが選択され、ステップ416ではその選択されたパターンが実行される。ステップ418では、検査が終了したか否かが判定され、終了していない場合にはステップ404にループバックする一方、終了した場合には自動検査を完了する。

かくして、検査パターンをライブラリ化し、パターン間の状態遷移機能を実現することで、検査パターンの再利用率が向上する。また、一画面上で上記の設定機能を可能とすることで、検査パターンの設計に要する工数が低減される。

18

請 求 の 範 囲

1. 制御装置の制御対象を模擬するシミュレート手段と、

前記制御装置に入力するパターン信号と該パターン信号に応じて 前記シミュレート手段から出力される出力信号との関係に基づいて 、前記制御装置の動作を検査する検査手段と、

を備え、

前記検査手段は、所定のタイミングで前記制御装置の動作を検査するものであり、前記制御装置の動作が正常であるとの判定が得られない場合には、所定回数のリトライ判定を行う、

制御装置の検査装置。

2. パターン信号を作成するパターン信号作成装置であって、

前記パターン信号作成装置によって作成された前記パターン信号を用いる装置の制御周期に基づいて、前記パターン信号を作成する第1の関数処理手段と、

前記制御周期とは異なる周期に基づいて、前記パターン信号を作 成する第2の関数処理手段と、

を備えるパターン信号作成装置。

- 3. 前記第2の関数処理手段は、複数の前記制御周期にわたる時間の周期に基づいて、前記パターン信号を作成する、請求項2に記載のパターン信号作成装置。
- 4. 前記第2の関数処理手段は、前記制御周期毎の周期に基づいて、前記パターン信号を作成する、請求項3に記載のパターン信号作成装置。
- 5. パターン信号を作成するパターン信号作成装置であって、 基準パターン信号に対する相関情報が指定された相関パターン信 号を作成する手段と、

該基準パターン信号と作成された該相関パターン信号とを同一画 面上に表示する表示手段と、

を備えるパターン信号作成装置。

6. パターン信号を作成するパターン信号作成装置であって、

基準パターン信号に対する相関情報が指定された相関パターン信号が存在する場合に、該基準パターン信号と該相関パターン信号とを同一画面上に表示する表示手段と、

前記基準パターン信号の変更と連動させて該相関パターン信号を変更するパターン信号連動変更手段と、

を備え、

前記表示手段は、前記基準パターン信号の編集が行われた場合には、前記基準パターン信号とともに、前記パターン信号連動変更手段によって変更された前記相関パターン信号の再表示を行うパターン信号作成装置。

7.制御装置にデータの出力を行わせるダイアグ機能の検査を行 うための検査プログラムを作成する検査プログラム作成装置であっ て、

前記制御装置で処理される前記パターン信号を画面上に表示する手段と、

前記パターン信号が画面上に表示された状態で、前記ダイアグ機能の検査における設定を可能とする手段と、

を備える検査プログラム作成装置。

- 8. 前記ダイアグ機能の検査における設定とは、前記制御装置に対するデータ出力要求情報および該データ出力要求情報を前記制御装置に要求した場合におけるダイアグ機能の正常もしくは異常の判定条件である、請求項7に記載の検査プログラム作成装置。
 - 9. 検査プログラムを作成する検査プログラム作成装置であって

制御装置に入力するパターン信号と該パターン信号間の遷移条件 とを含む子プロジェクトと、

前記子プロジェクトと前記子プロジェクト間の遷移条件とを含む 親プロジェクトと、

前記子プロジェクトの編集画面と、前記親プロジェクトの編集画面とを同時に表示する表示手段と、

前記表示手段に表示された前記親プロジェクトの編集画面における前記子プロジェクトを選択すると、該選択された子プロジェクトの内容を前記子プロジェクトの編集画面に表示し、編集可能とする第1の編集手段と、

前記表示手段に表示された前記子プロジェクトの編集画面における前記子プロジェクトの内容を選択すると、該選択された前記子プロジェクトの内容の設定情報を新たな編集画面に表示し、編集可能とする第2の編集手段と、

を備える検査プログラム作成装置。

10.制御装置の検査装置であって、

前記制御装置に入力するパターン信号と該パターン信号に応じて 前記制御装置の制御対象から出力される出力信号との関係に基づい て、前記制御装置の動作を検査する検査手段と、

前記検査手段が前記パターン信号を実行しているときに他の前記パターン信号の実行に移行するためのパターン信号遷移条件が成立した場合に、前記検査手段を該他の前記パターン信号の実行に移行させる手段と、

を備える、制御装置の検査装置。

11. 制御装置の動作を検査する検査方法であって、

前記制御装置の制御対象を模擬するシミュレートステップと、

前記制御装置に入力するパターン信号と該パターン信号に応じて 前記シミュレートステップで出力された出力信号との関係に基づい て、前記制御装置の動作を検査する検査ステップと、を含み、

前記検査ステップは、所定のタイミングで前記制御装置の動作を 検査するものであり、前記制御装置の動作が正常であるとの判定が 得られない場合には、所定回数のリトライ判定を行うことを特徴と する制御装置の検査方法。

12. パターン信号を作成する方法であって、

前記パターン信号を用いる装置の制御周期に基づいて、前記パターン信号を作成する第1の関数処理ステップと、

前記制御周期とは異なる周期に基づいて、前記パターン信号を作成する第2の関数処理ステップと、

を備えることを特徴とするパターン信号作成方法。

- 13.前記第2の関数処理ステップは、複数の前記制御周期にわたる時間の周期に基づいて、前記パターン信号を作成することを特徴とする、請求項12に記載のパターン信号作成方法。
- 14.前記第2の関数処理ステップは、前記制御周期毎の周期に基づいて、前記パターン信号を作成することを特徴とする、請求項13に記載のパターン信号作成方法。
 - 15. パターン信号を作成する方法であって、

基準パターン信号を作成するステップと、

該基準パターン信号に対する相関情報が指定された相関パターン 信号を作成するステップと、

該基準パターン信号と作成された該相関パターン信号とを同一画 面上に表示する表示ステップと、

を備えることを特徴とするパターン信号作成方法。

16. パターン信号を作成する方法であって、

基準パターン信号に対する相関情報が指定された相関パターン信号が存在する場合に、該基準パターン信号と該相関パターン信号とを同一画面上に表示する表示ステップと、

前記基準パターン信号の変更と連動させて該相関パターン信号を 変更するパターン信号連動変更ステップと、

前記基準パターン信号の編集が行われた場合には、前記基準パターン信号とともに、前記パターン信号連動変更ステップによって変更された前記相関パターン信号の再表示を行うステップと、

を備えることを特徴とするパターン信号作成方法。

17.制御装置にデータの出力を行わせるダイアグ機能の検査を 行うための検査プログラムを作成する検査プログラム作成方法であ って、

前記制御装置で処理される前記パターン信号を画面上に表示するステップと、

前記ダイアグ機能の検査における設定を可能とするステップと、 を備えることを特徴とする検査プログラム作成方法。

18.前記ダイアグ機能の検査における設定とは、前記制御装置に対するデータ出力要求情報および該データ出力要求情報を前記制御装置に要求した場合におけるダイアグ機能の正常もしくは異常の判定条件であることを特徴とする、請求項17に記載の検査プログラム作成方法。

19.制御装置に入力するパターン信号と該パターン信号間の遷移条件とを含む子プロジェクトと、前記子プロジェクトと前記子プロジェクトと前記子プロジェクト間の遷移条件とを含む親プロジェクトと、を備えた検査プログラムを作成する検査プログラム作成方法であって、

前記子プロジェクトの編集画面と、前記親プロジェクトの編集画面とを同時に表示する表示ステップと、

前記表示ステップで表示された前記親プロジェクトの編集画面に おける前記子プロジェクトを選択すると、該選択された子プロジェ クトの内容を前記子プロジェクトの編集画面に表示し、編集可能と する第1の編集ステップと、

前記表示ステップで表示された前記子プロジェクトの編集画面に おける前記子プロジェクトの内容を選択すると、該選択された前記 子プロジェクトの内容の設定情報を新たな編集画面に表示し、編集 可能とする第2の編集ステップと、

を備えることを特徴とする検査プログラム作成方法。

20.前記制御装置に入力するパターン信号と該パターン信号に応じて前記制御装置の制御対象から出力される出力信号との関係に基づいて、前記制御装置の動作を検査する制御装置の検査方法であって、

前記パターン信号を実行するステップと、

前記実行をしているときに他の前記パターン信号の実行に移行するためのパターン信号遷移条件が成立した場合に、該他の前記パターン信号の実行に移行するステップと、

を備えることを特徴とする制御装置の検査方法。

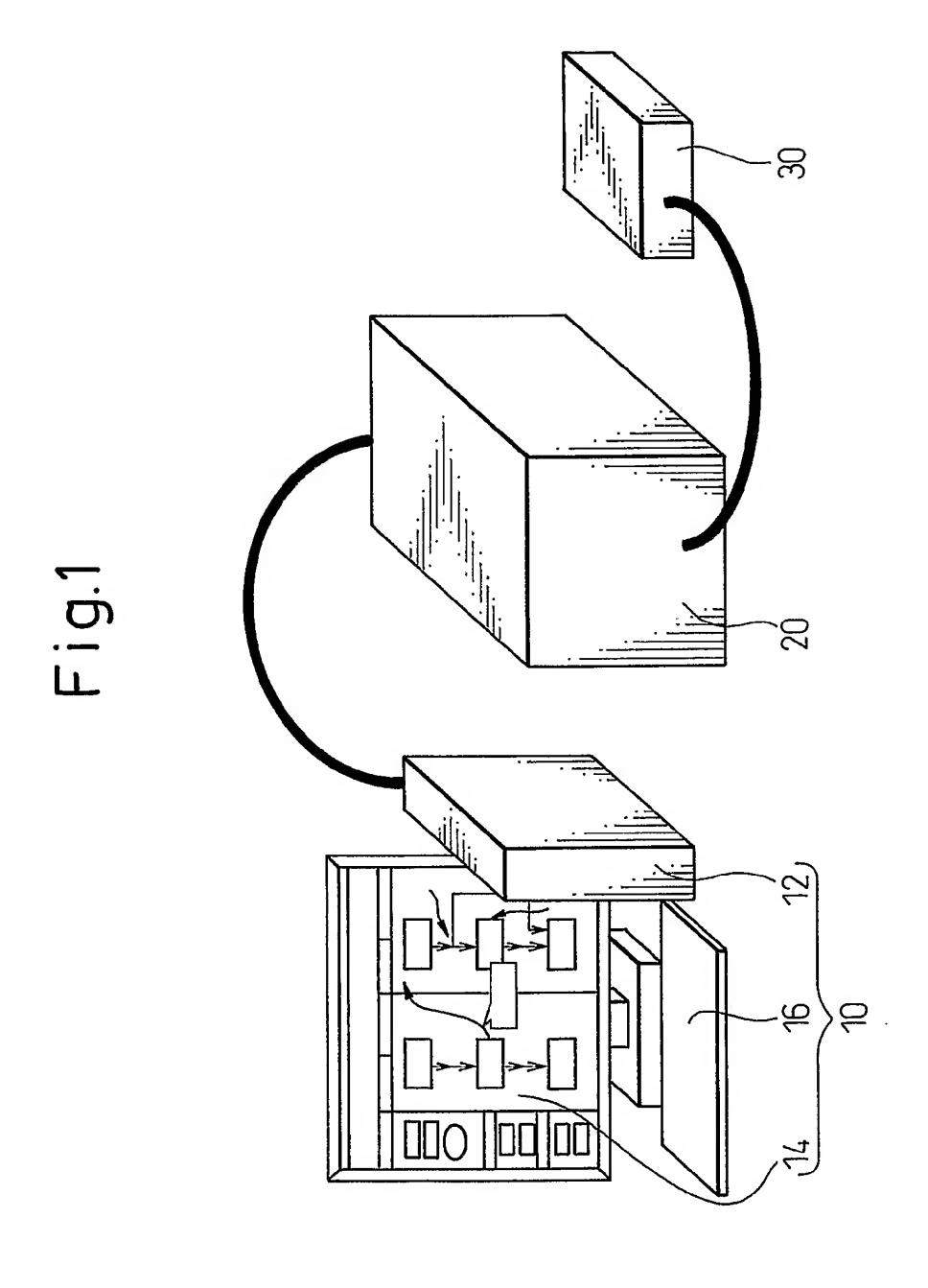
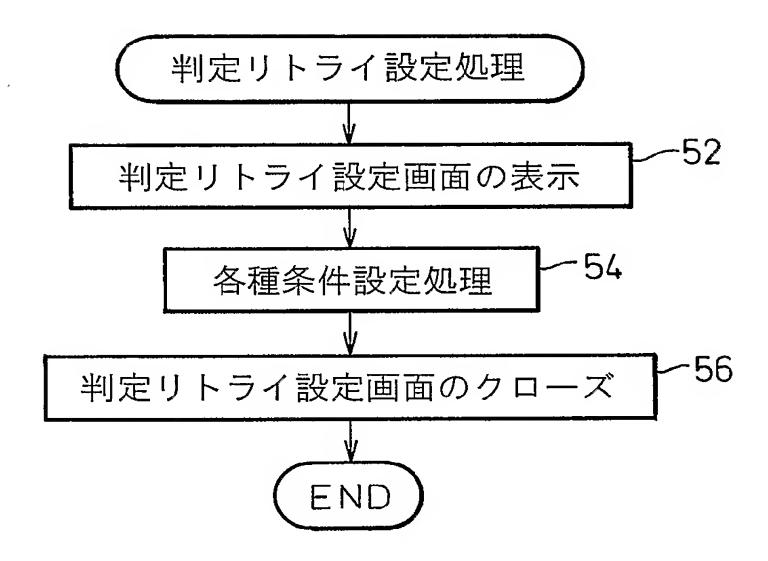


Fig.2



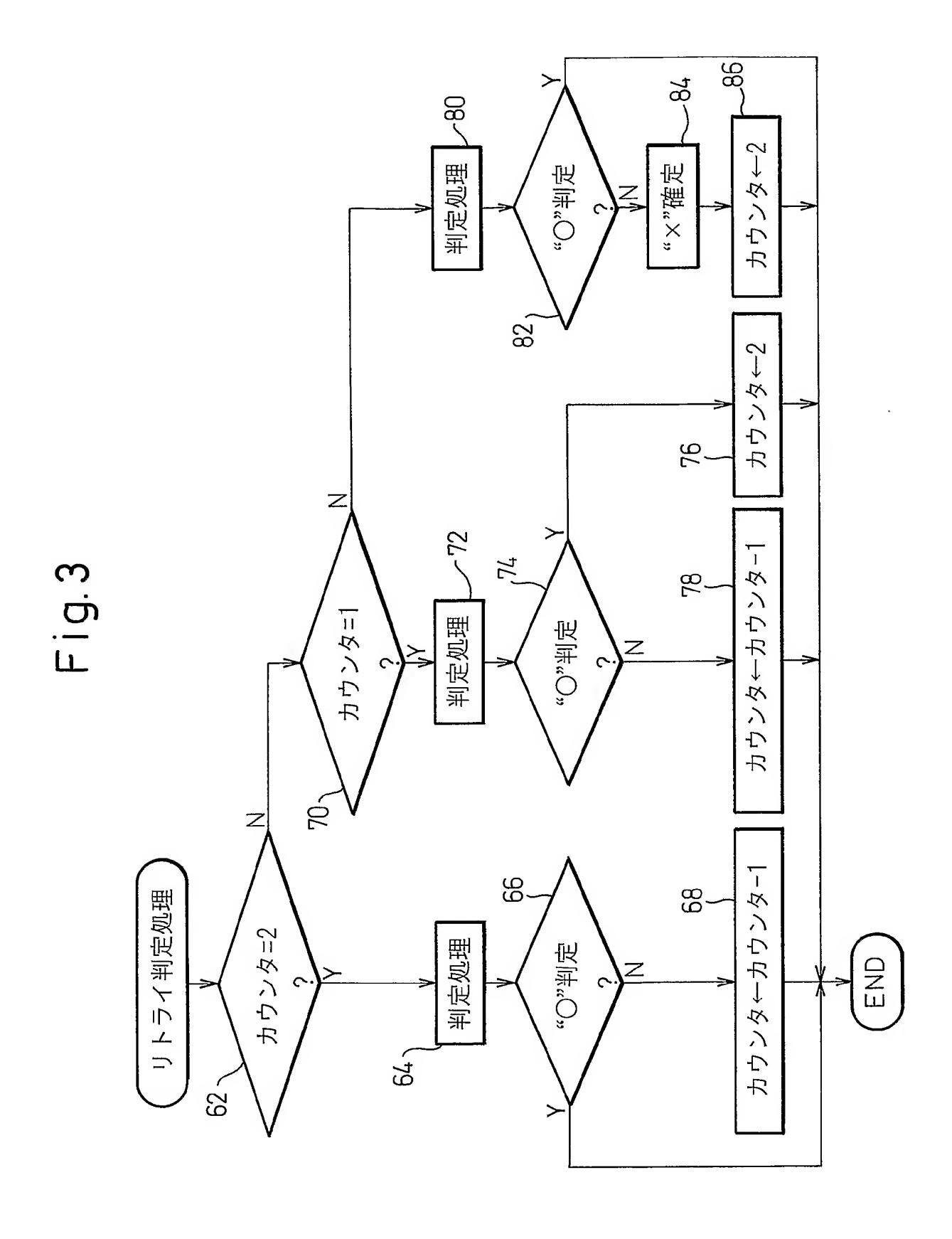


Fig. 4

▼通常判定

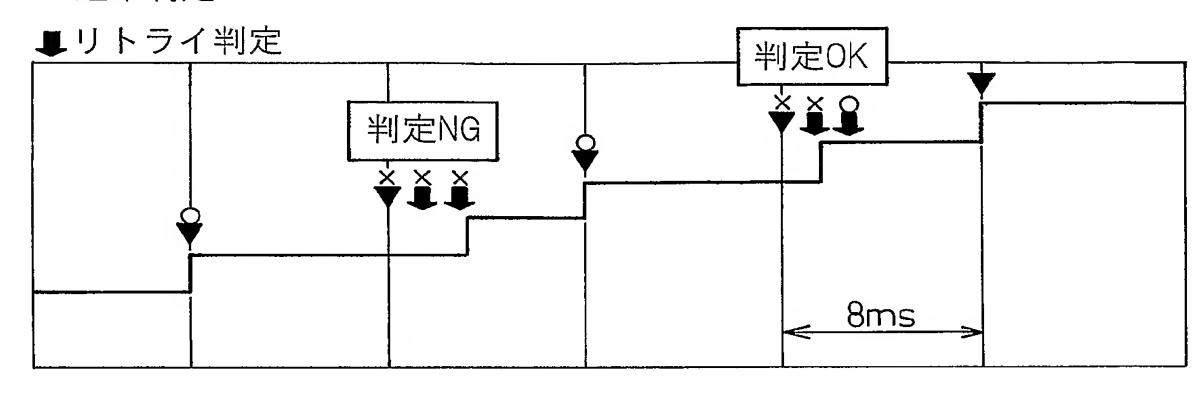


Fig.5A

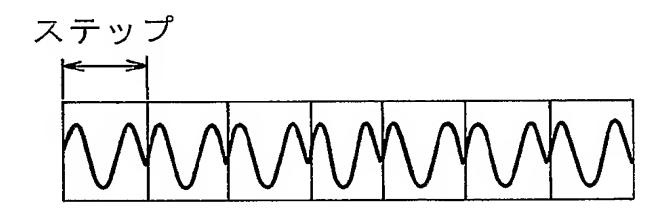


Fig.5B

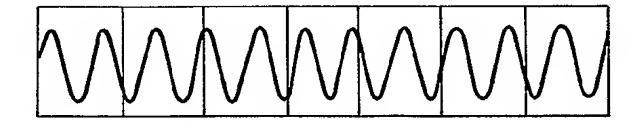


Fig.5C

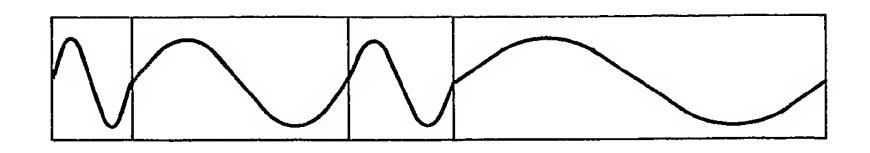


Fig. 6

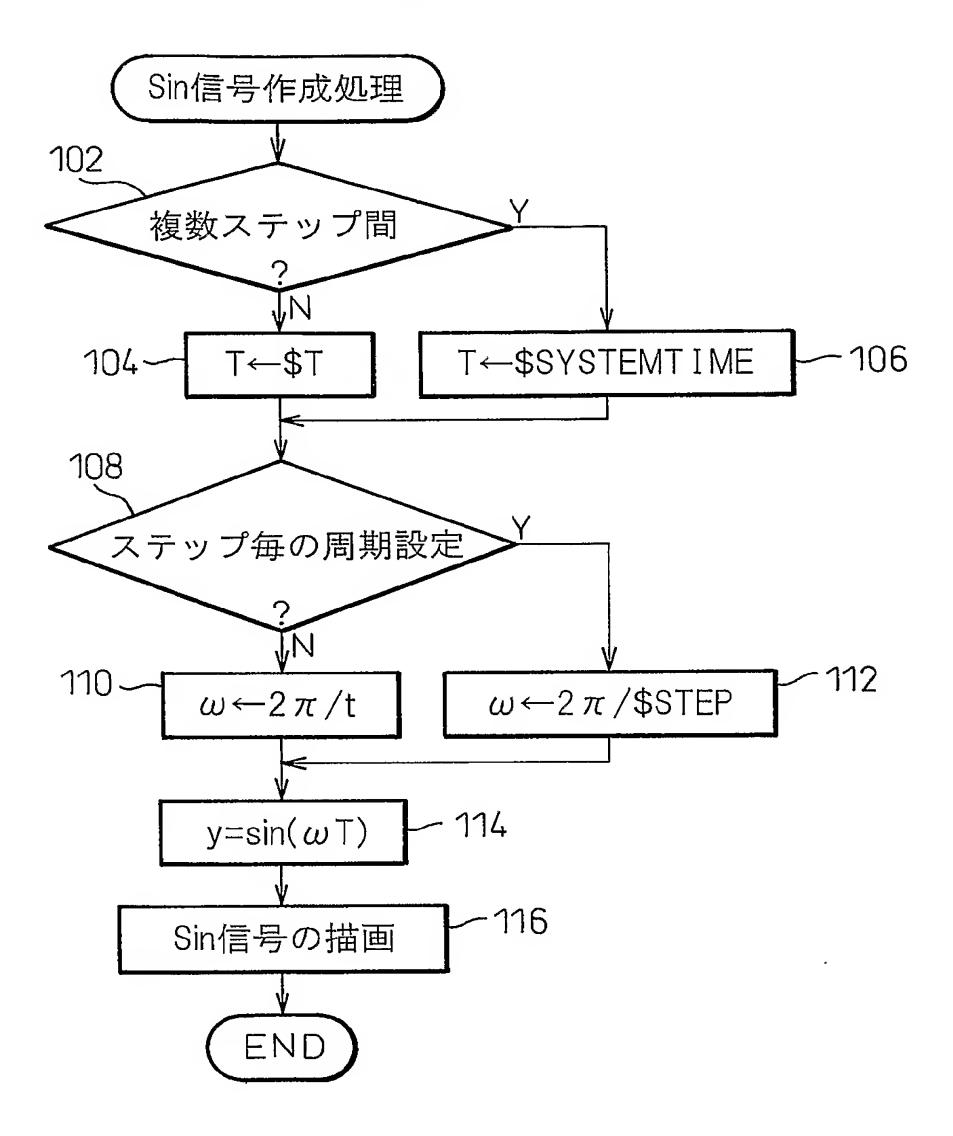


Fig.7

信号名	В
関数	A*36

Fig. 8

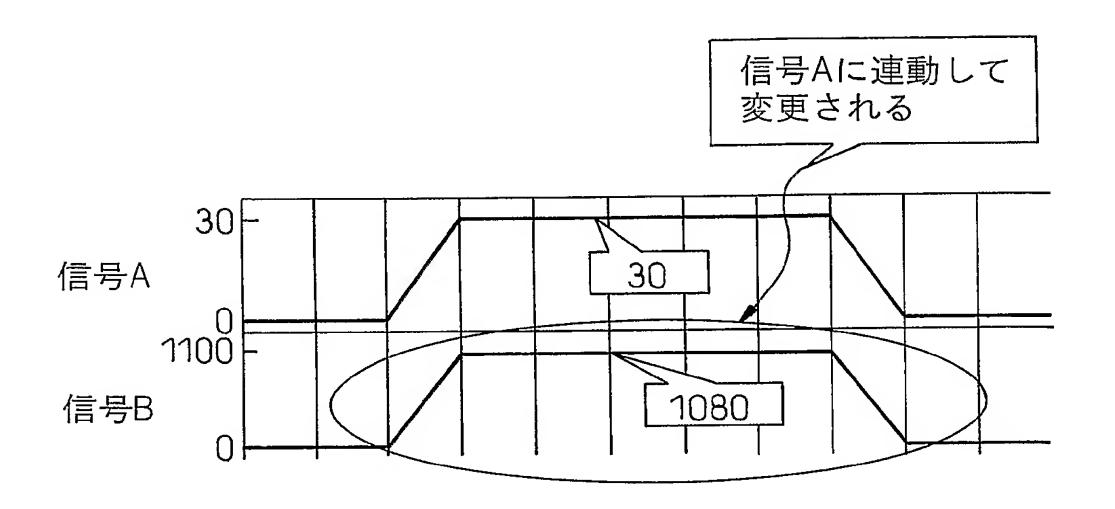


Fig. 9

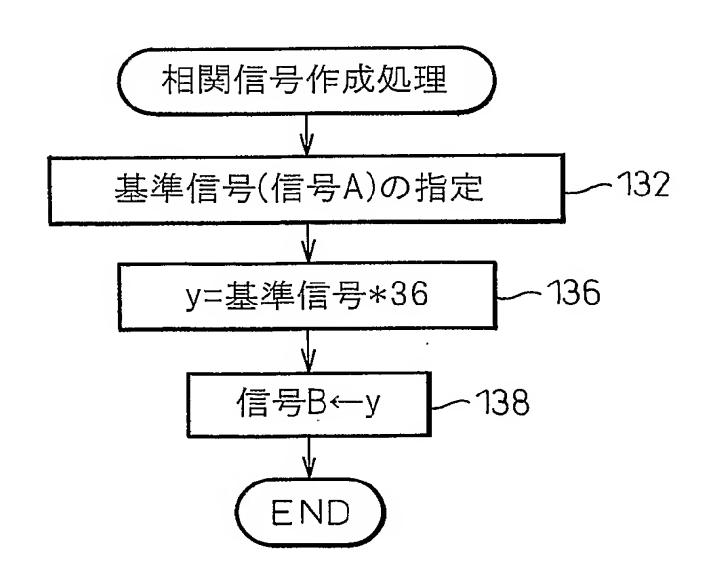
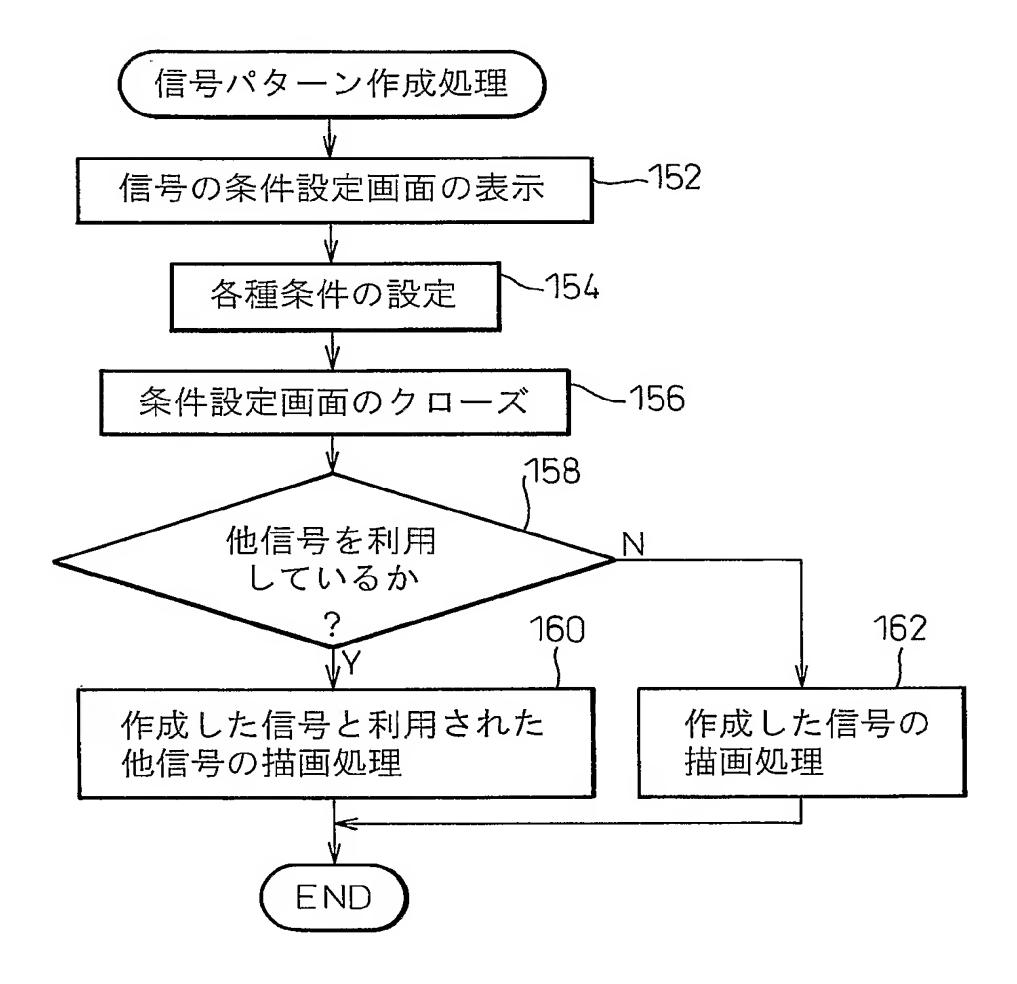


Fig.10



F.0.1

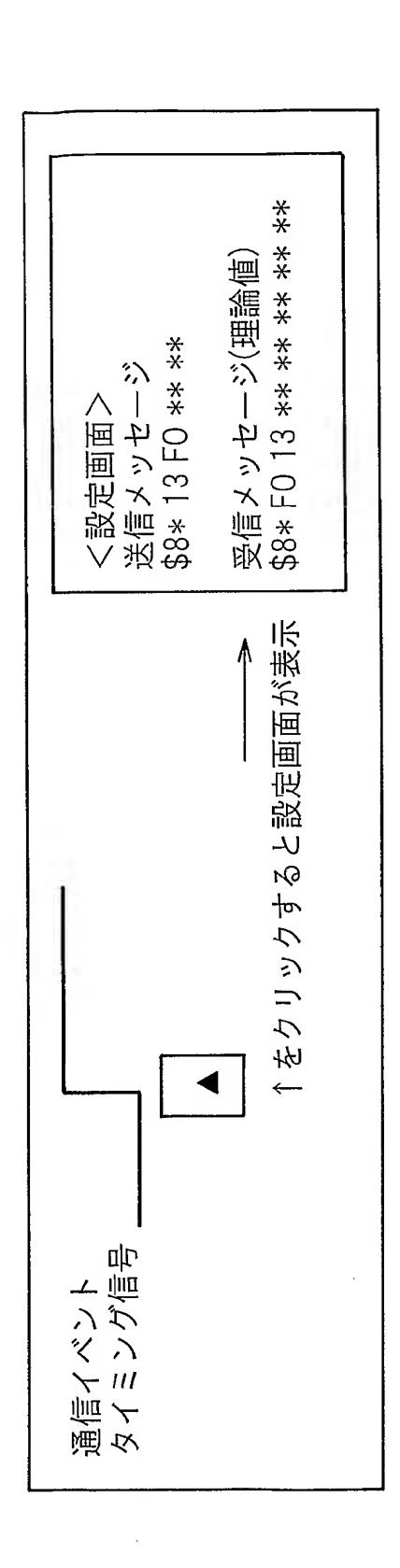


Fig.12

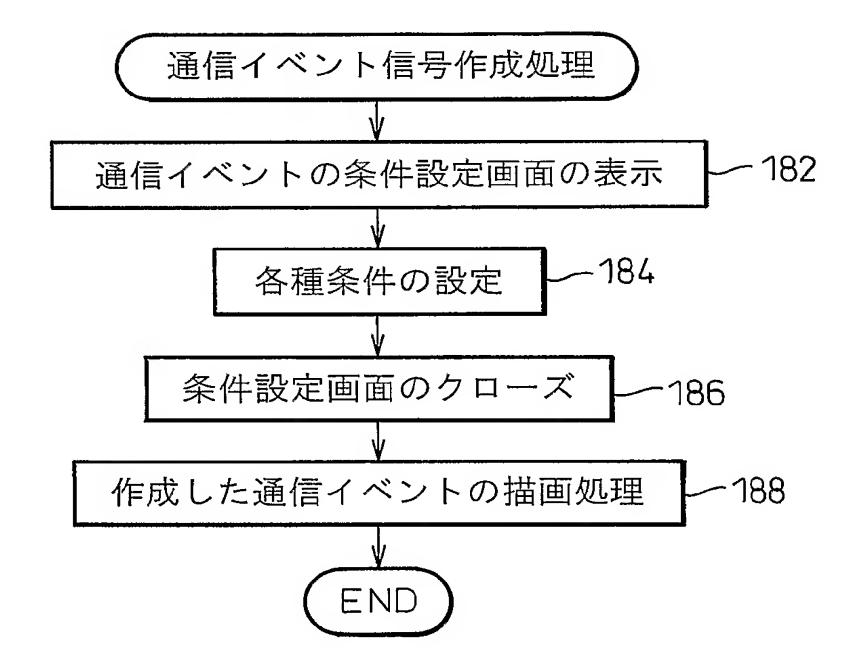
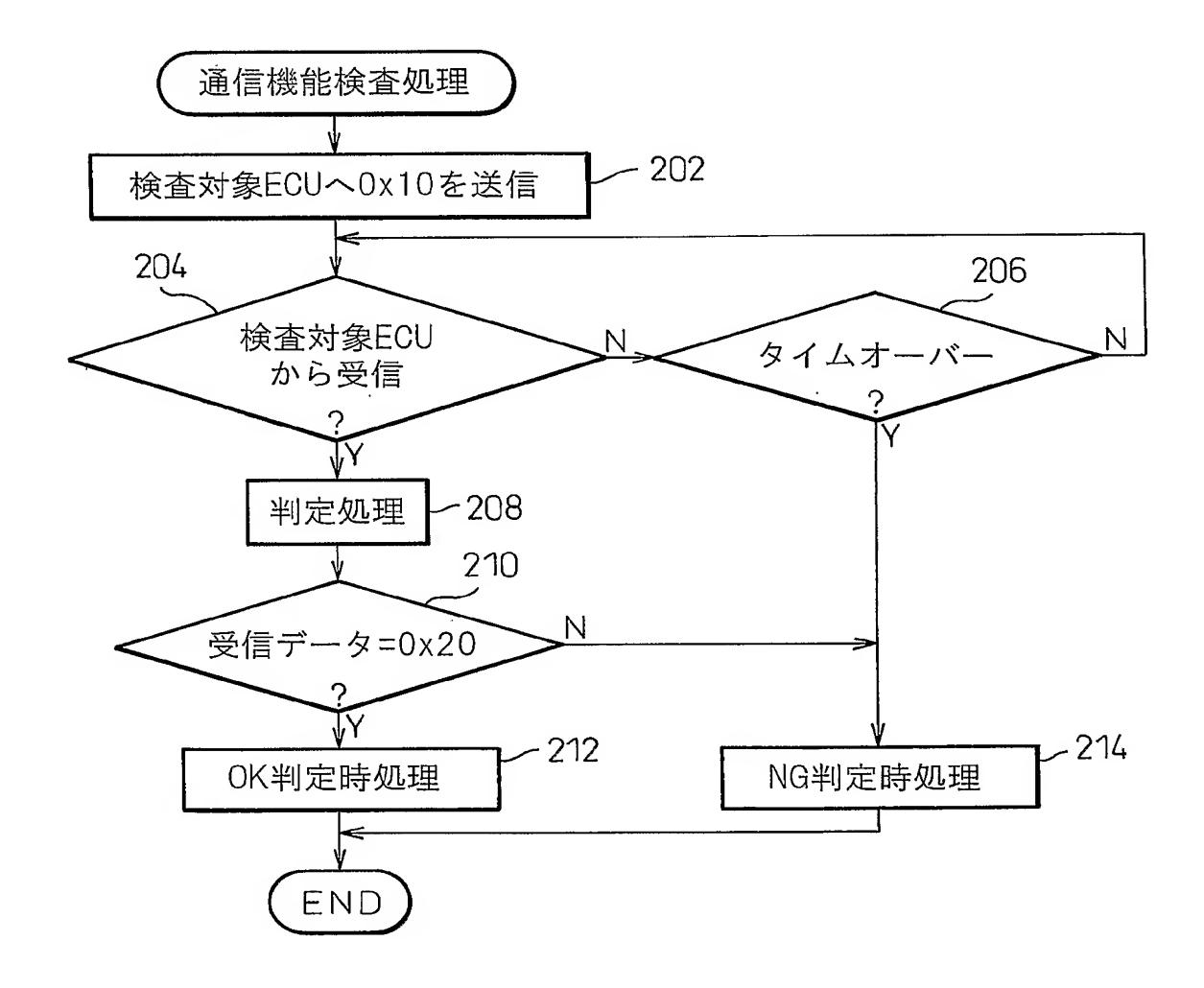


Fig.13



ーンエディタ 自動検査パタ 自動検査プロ ・プロジ: ・プロジ: 自動検査プロジェクト設定機能(親) ・プロジェクト編集機能 ・プロジェクト保存・読出機能

ト編集機能 ト保存・読出機能 HH

-ン編集機能-ン保存・読出機能

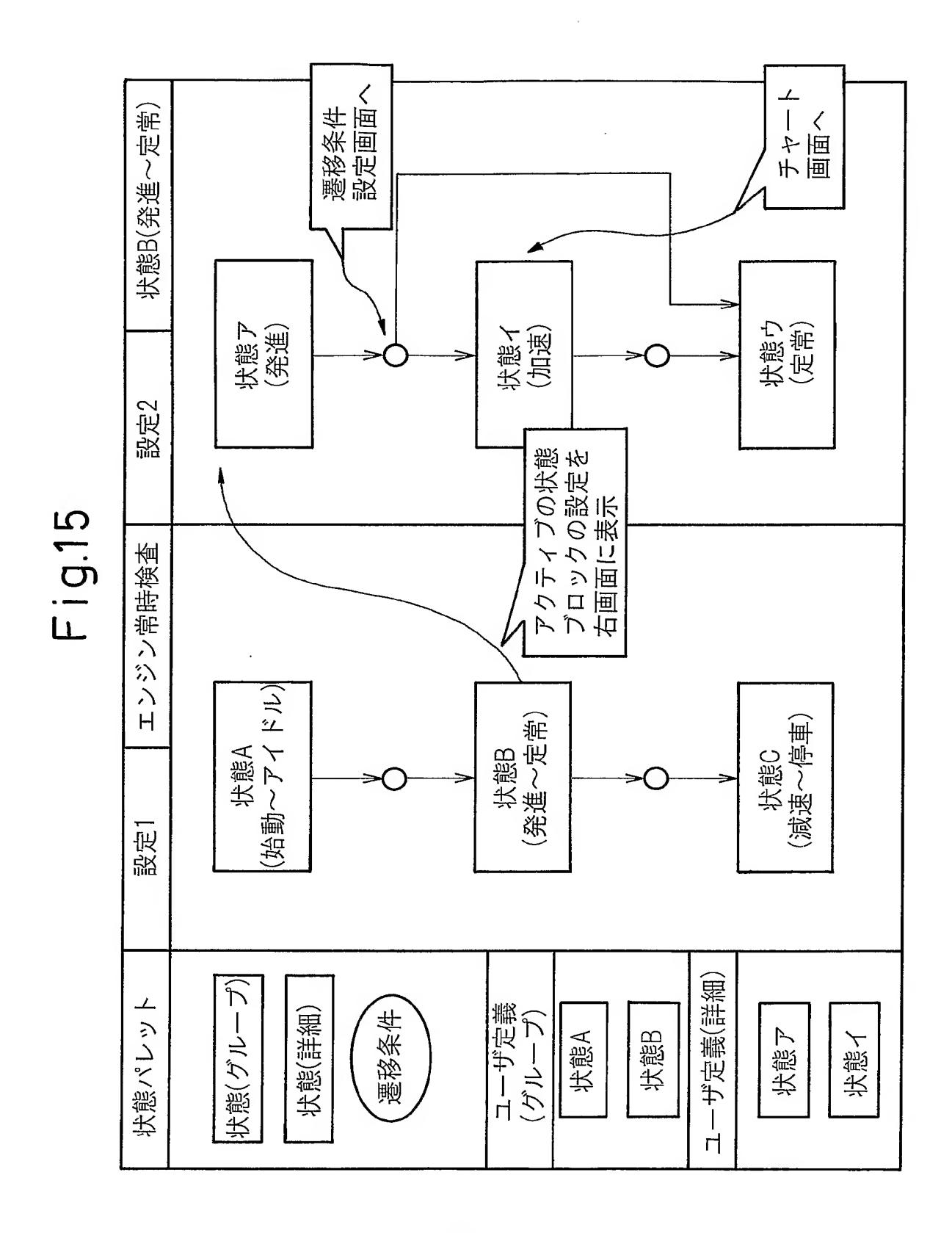
ペペ タタ

ふな

動検査

<u>ト</u>タ シミュフ 自動検査パターン遷移機能 ・遷移条件監視機能 ・パターン切り換え機能

自動検査パターン実行機能



12/16

Fig.16

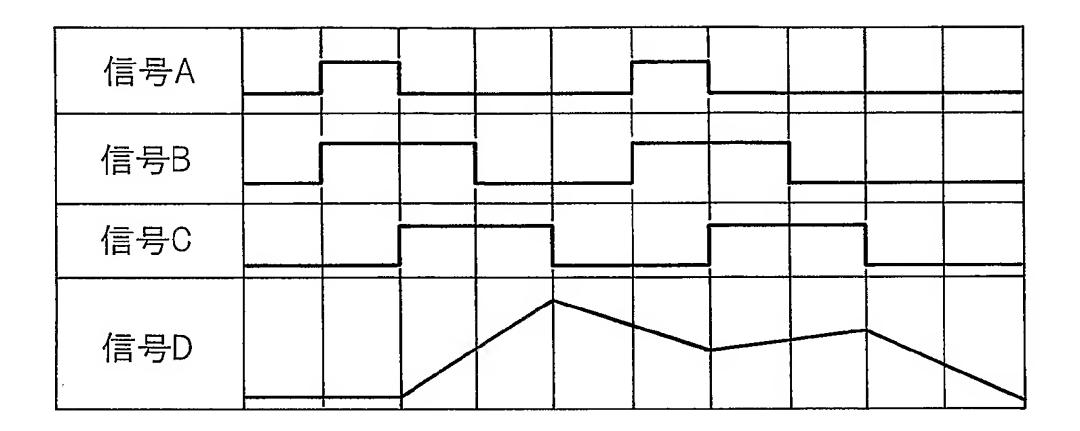


Fig.17

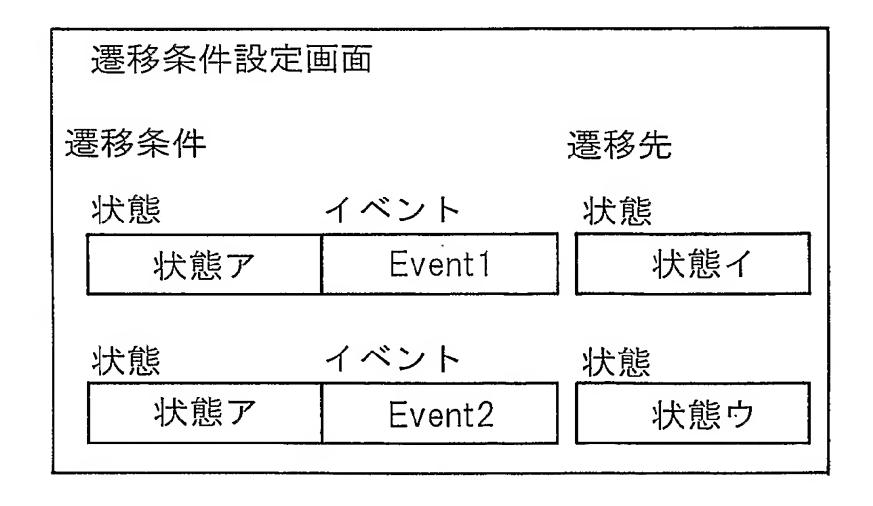


Fig.18

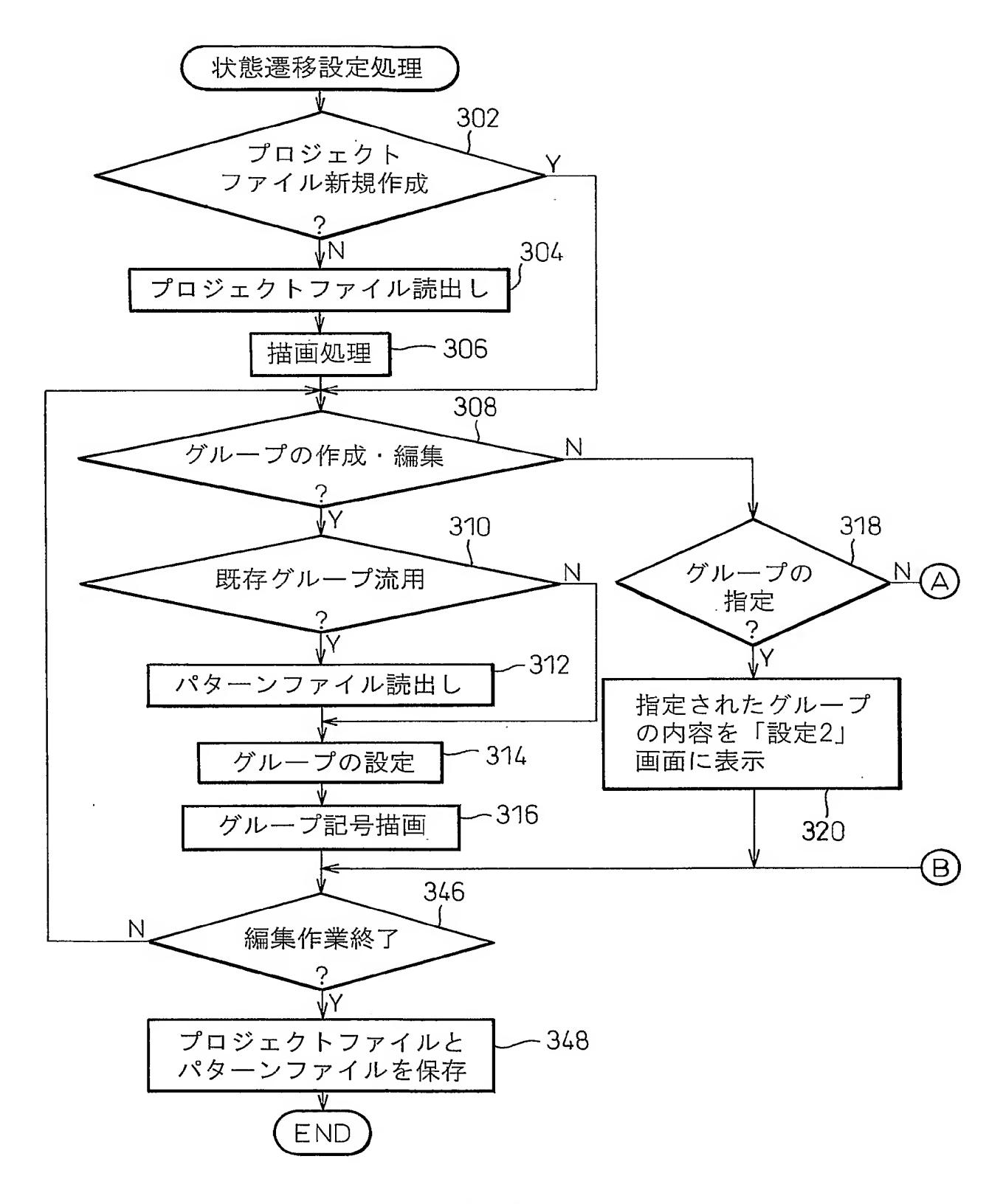


Fig.19

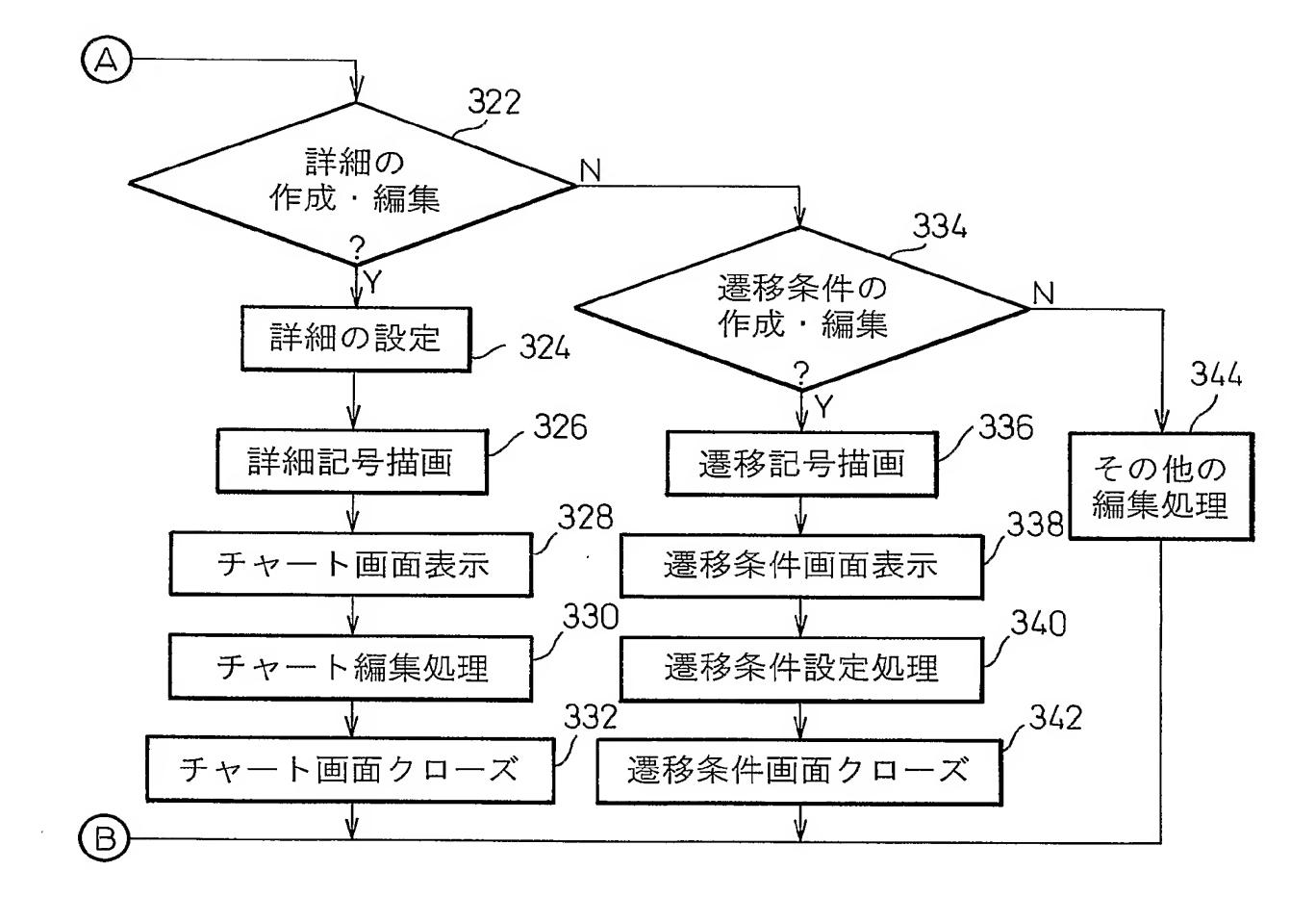
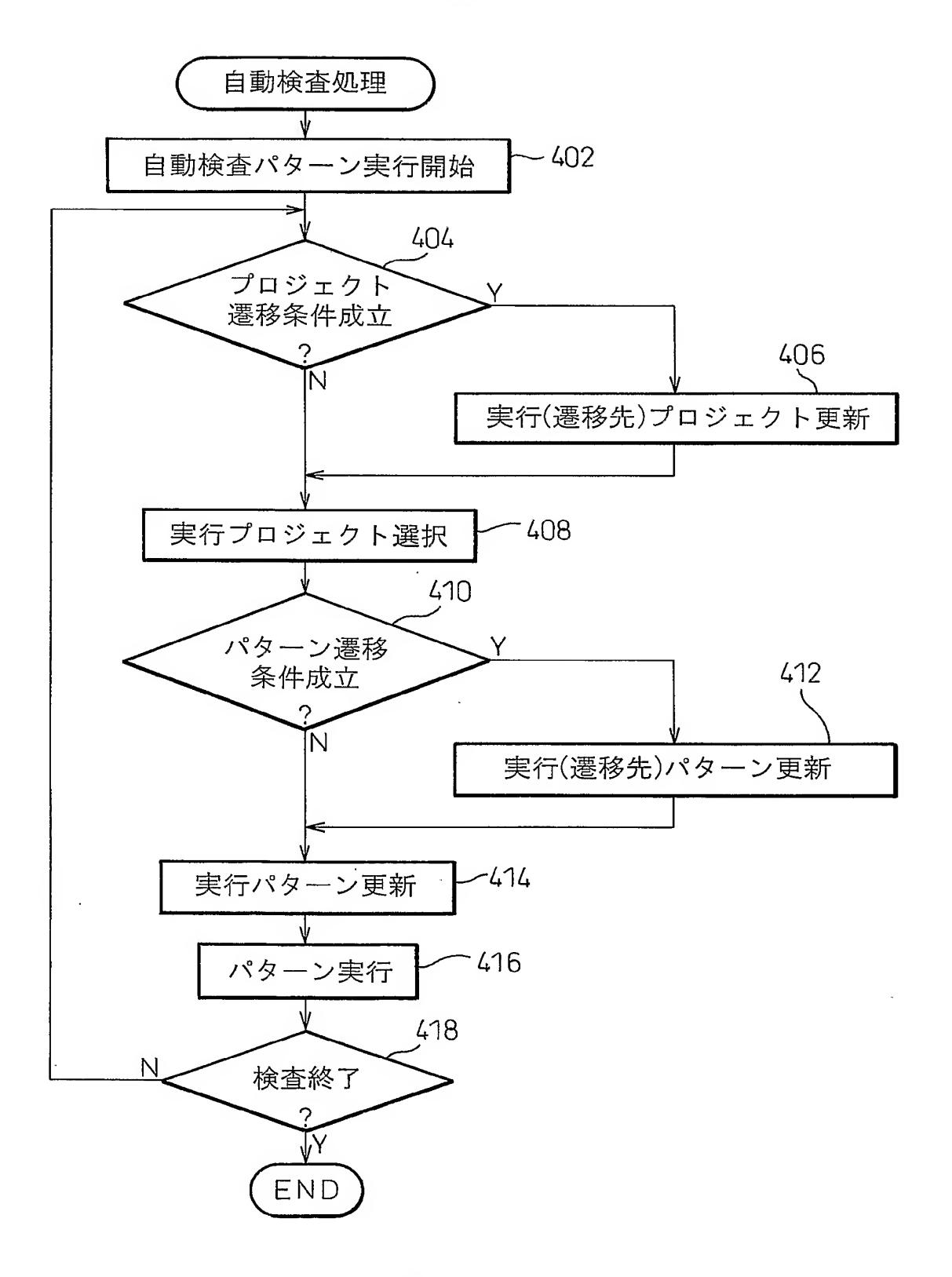


Fig. 20



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2004/017970

_	CATION OF SUBJECT MATTER 7 G01R31/3183				
According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC					
B. FIELDS SE	EARCHED				
	nentation searched (classification system followed by cl G01R31/28-31/3193	assification symbols)			
Jitsuyo	ocumentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Jitsuyo Shinan Koho 1922-1996 Jitsuyo Shinan Toroku Koho 1996-2005 Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971-2005 Toroku Jitsuyo Shinan Koho 1994-2005				
Electronic data b	pase consulted during the international search (name of o	data base and, where practicable, search ter	ms used)		
C. DOCUMEN	NTS CONSIDERED TO BE RELEVANT				
Category*	Citation of document, with indication, where ap	propriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.		
X	JP 2003-114254 A (Matsushita Industrial Co., Ltd.), 18 April, 2003 (18.04.03), Full text; all drawings (Family: none)	Electric	1,11		
X	JP 2-24584 A (NEC Corp.), 26 January, 1990 (26.01.90), Full text; all drawings (Family: none)		2-6,12-16		
X	JP 4-32784 A (Mitsubishi Electric Corp.), 04 February, 1992 (04.02.92), Full text; all drawings (Family: none)		7-10,17-20		
× Further do	cuments are listed in the continuation of Box C.	See patent family annex.			
* Special categories of cited documents: "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance		"T" later document published after the interdate and not in conflict with the applicate the principle or theory underlying the interdate the principle of the p	ion but cited to understand vention		
 "E" earlier application or patent but published on or after the international filing date "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other 		"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone			
special reaso	on (as specified)	"Y" document of particular relevance; the cla considered to involve an inventive st combined with one or more other such d	ep when the document is		
"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed		being obvious to a person skilled in the a "&" document member of the same patent fail	art		
Date of the actual completion of the international search 28 February, 2005 (28.02.05)		Date of mailing of the international search, 2005 (15.			
Name and mailing address of the ISA/ Japanese Patent Office		Authorized officer			
Facsimile No.		Telephone No.			

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No. PCT/JP2004/017970

C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT					
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.			
A	JP 2003-270300 A (Ricoh Co., Ltd.), 25 September, 2003 (25.09.03), Full text; all drawings (Family: none)	1-20			
A	JP 2001-124811 A (Clarion Co., Ltd.), 11 May, 2001 (11.05.01), Full text; all drawings & EP 1224432 A2 & US 6778934 B1 & WO 2001/031285 A2 & CN 1382271 A & TW 580577 A & HU 200203690 B & MX 2002003985 A1	1-20			
		-			

発明の属する分野の分類(国際特許分類(IPC)) Int. C17 G01R 31/3183 調査を行った分野 調査を行った最小限資料(国際特許分類(IPC)) Int. C17 G01R 31/28-31/3193 最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの 日本国実用新案公報 1922-1996年 日本国公開実用新案公報 1971-2005年 日本国実用新案登録公報 1.996-2005年 日本国登録実用新案公報 1994-2005年 国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語) C. 関連すると認められる文献 引用文献の 関連する カテゴリー* 請求の範囲の番号 引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示 JP 2003-114254 A (松下電器産業株式会社) X 1, 11 2003.04.18,全文,全図(ファミリーなし) \mathbf{X} JP 2-24584 A (日本電気株式会社) 2 - 6, 1990.01.26,全文,全図(ファミリーなし) 12 - 16JP 4-32784 A (三菱電機株式会社) \mathbf{X} 7 - 10, 1992.02.04,全文,全図(ファミリーなし) 17 - 20 $|\mathbf{X}|$ C欄の続きにも文献が列挙されている。 パテントファミリーに関する別紙を参照。 * 引用文献のカテゴリー の日の後に公表された文献 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって もの 出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日 の理解のために引用するもの 以後に公表されたもの 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 の新規性又は進歩性がないと考えられるもの 日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以 文献(理由を付す) 上の文献との、当業者にとって自明である組合せに 「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献 よって進歩性がないと考えられるもの 「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願 「&」同一パテントファミリー文献 国際調査を完了した日 国際調査報告の発送日 28. 02. 2005 15.03.2005 国際調査機関の名称及びあて先 特許庁審査官(権限のある職員) 9805 2 S 日本国特許庁(ISA/JP) 武田 知晋 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号 電話番号 03-3581-1101 内線 3256

C (続き)・	関連すると認められる文献	HH NA 1 - NA
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
A	JP・2003-270300 A (株式会社リコー) 2003.09.25,全文,全図, (ファミリーなし)	1 - 2 0
A	JP 2001-124811 A (クラリオン株式会社) 2001.05.11,全文,全図 & EP 1224432 A2 & US 6778934 B1 & WO 2001/031285 A2 & CN 1382271 A & TW 580577 A & HU 200203690 B & MX 2002003985 A1	1-20